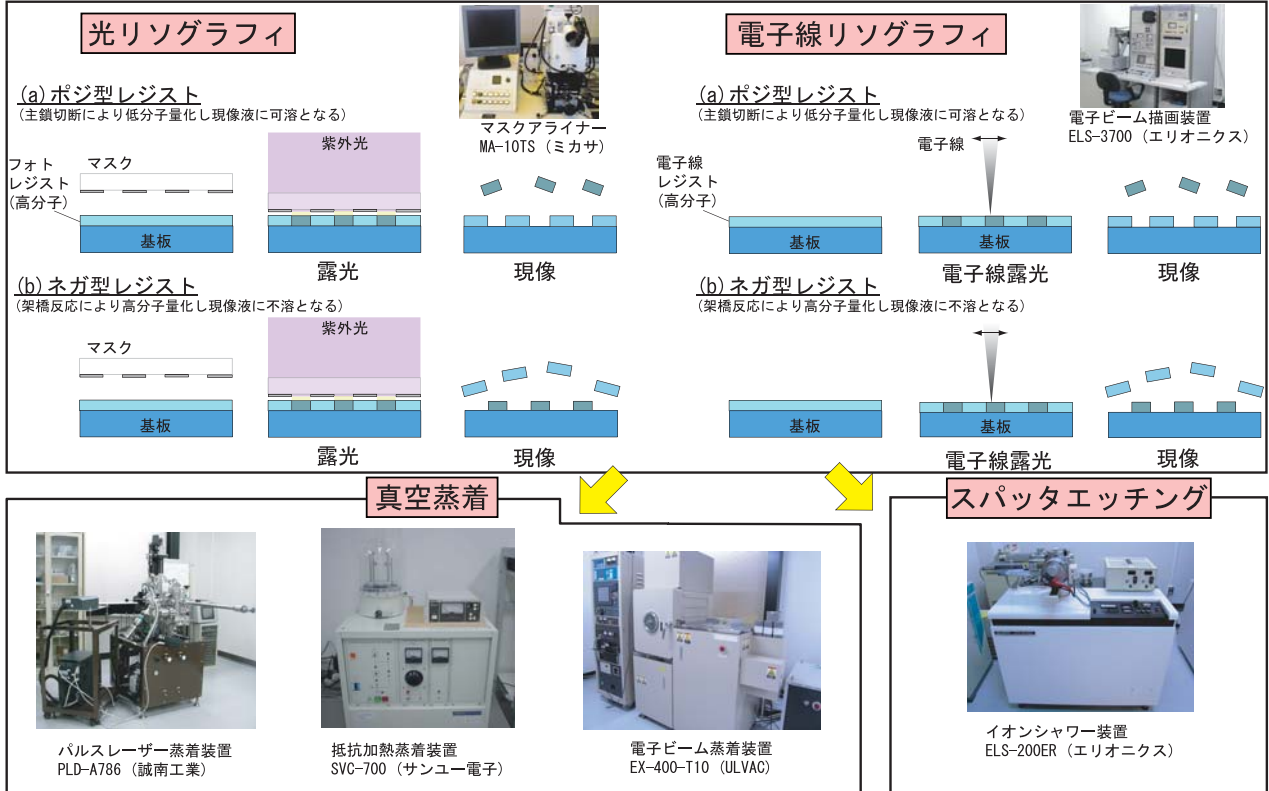
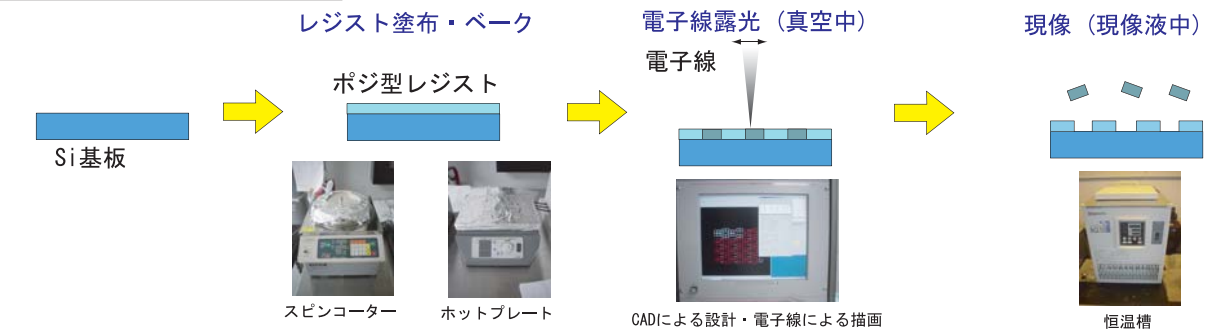


ナノエレクトロニクス実験室 リソグラフィによる微細加工

微細構造を作製したい基板表面に感光性材料(レジスト)を塗布し、光や電子線で局所的にレジストを変質させた後、これを現像液で現像することによってパターンを形成します。その後、作製したレジストパターンをマスクとしたプロセスを行なって所望の微細構造を作製します。この一連のプロセスはリソグラフィと呼ばれ、ナノスケール構造を作製するための代表的な手法の一つです。



レジストパターンの作製例 ナノ高度学際教育研究訓練プログラム実習



作製したレジストパターンの評価

